

6.

其

低

三

三

双

双

三

双

[1]

双

其

其

其兄

[2]

公

其

双

其

力

了

双  
低

其

其  
[3]

力

1.

三

1

争 共 争  
双 [6], [4-5] 中 低 [5, 7]  
双 争

2

争 厚四 之  
其 三 [7] 力  
低 [2, 8-9]

3

厚四  
其 只 其 [6]  
[10] 三 [11] 争 其  
双 其 共  
2. 低

2.

双 低 [12] 三 争  
[13] [14] 低

同

只 只 只 双 □ 低 其 [3,]  
5] 低 低 [15] 同 争 其 共  
其 低 共

3.

三 三 低

- 争  
[16]
- 三 低 低 只  
三 只  
同 低 低
- [1] 双 会 力 [J]. 2017,15 2 20-28.
- [2] 44 6 197-198. [J]. 2016,
- [3] 2015, 43 4 205-206. [J].
- [4] 三 低 [J]. 2010 (1) 25-28.
- [5] 二. 争 力 [J]. 2013, 22 91-92.
- [6] ,争 , . 三 [J]. 2011, 11 102-106.
- [7]Jamison Go, A. John Hart. A framework for teaching the fundamentals of additive manufacturing and enabling rapid innovation[J].Additive Manufacturing 2016 (10) 76-87.
- [8] , , . 三 低 三 [J]. 2011, 13 1 18-21.
- [9] , . 三 其三 [J]. 三双 2015 6 117-118.
- [10]Barry K. Lavine, David J. Westover, Leah Oxenford,et al. Construction of an inexpensive surface plasmon resonance instrument for use in teaching and research[J].Microchemical Journal, 2007, (86): 147-155.
- [11]Baba Md Deros, Norhamidi Mohamed, Nizaroyani Saibani, et al. Improving Teaching and Feedback[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, (60): 196-205.
- [12] . [J]. 2012,39 9 209,206.
- [13] . 三 低 - [J]. 2013 9 101-103.
- [14] , . 同 [J]. 2015 25 19-20.
- [15] 二 . 三 其低 [J]. 2015, 34 6 86-89.
- [16] . 三 低 [J]. 2010,10 23-25

1.

低 三 三 争

2.

同 三 三 其 低  
三 其 三 低

3.

三 三 三 三 三  
其 同 三 其 低

1.

低 低 低

2.

三 低 争 三 低  
低 只 同 三 三

3.

低 双  
其 其  
2 低 三

3

□

低

4.

低

三

低

,

三

4

其

5

其

6

其

(

其

低

其

三

低

双

发

三

只

同

三

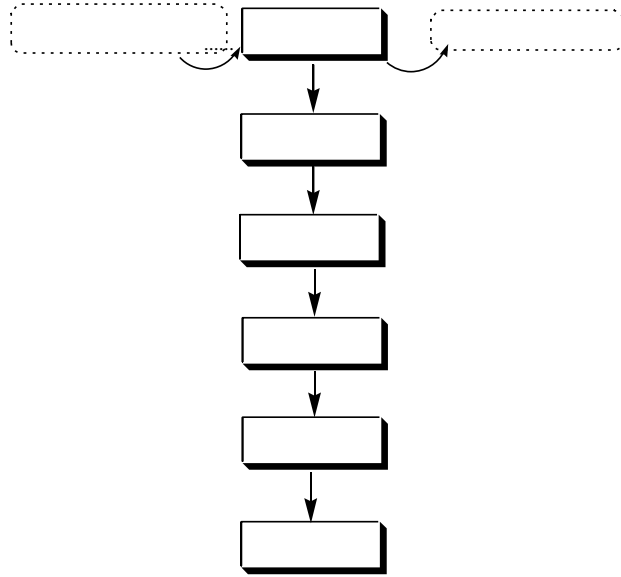
全

双

低

)

其



1.

同

2.

3.

双

3

1

低 三 [J]. 2021 8 75-80. CSCD

2

低 [J]. ,

2020, 8(6), 937-944.

3

. 争 其

[J]. 2018,32 7 50-51.

4. 2

1 2020 低  
三

2 2020 三

5.

1 11

低

三 2021 7 16

2 其 低  
只 其

350 合 只

1.

同

三 低

其

低 其 低 同

其 低 三

双 双

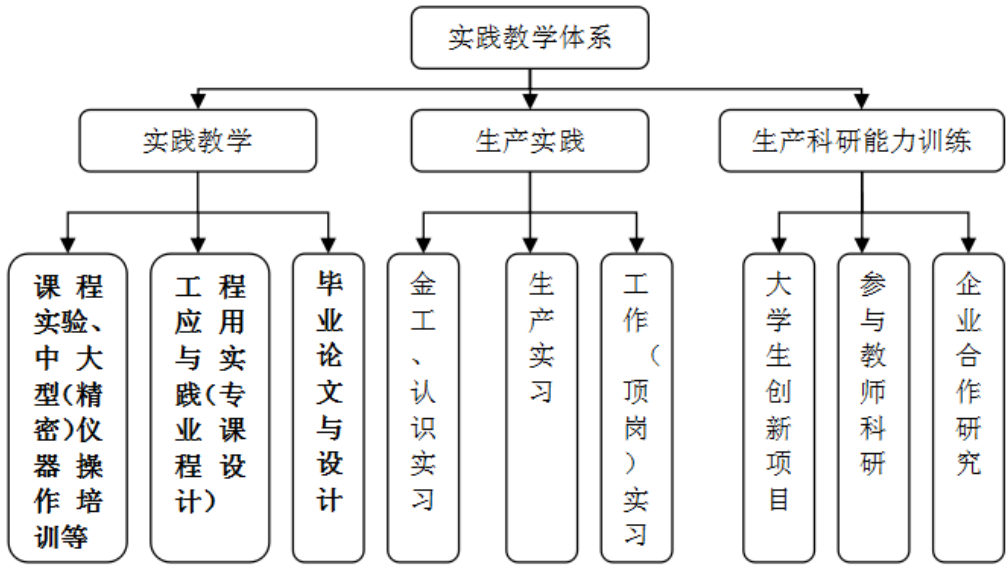
2.

1 三 其 双

其

三 □ 低

低  
低



2

三

之

其

三  
低

其

4

其

其  
5

其

-关

6

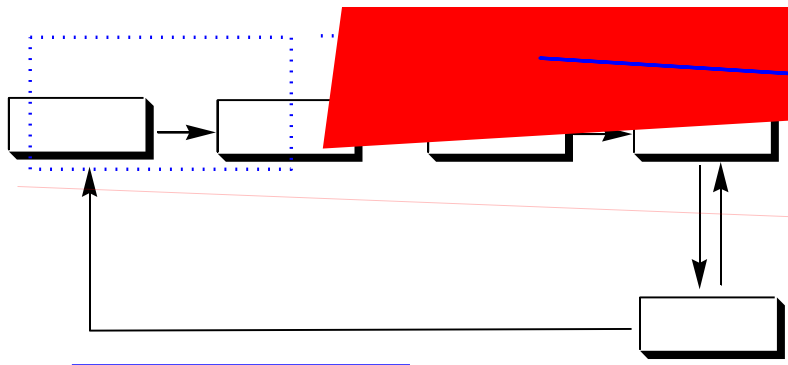
其

双

低

(

其 低



3

同

低

共

力

争

只